# 微电子器件实验 MOS 管直流特性

范云潜, 学号: 18373486, 搭档: 徐靖涵, 教师: 彭守仲

微电子学院 184111 班

日期: 2020年10月19日

### 1 实验目的

从场效应管的直流特性特性的测量与分析中,验证并加深对场效应管原理与性质的理解。

## 2 实验所用设备及器件

主要设备有: 电压源,手持式万用表,台式万用表,相关线缆等,主要器件有 N 沟道 MOS 管 IRF3205 和 IRFR214。

## 3 实验基本原理及步骤

### 3.1 MOS 管基本结构

场效应管(Field Effect Transistor, FET)是一种压控电流元件,仅靠多子进行导电,又称为单极型晶体管,并且体积小、重量轻、寿命长、噪音低、热稳定性好、耗电低是现代的超大规模数字集成电路(Very Large Scale Integration, VLSI)的基本器件。

FET 主要可以分为结型场效应管(Junction Field Effect Transistor, JFET)和绝缘栅型场效应管(Insulated Gate Effect Transistor, IGFET)。后者有常见的金属-氧化物-半导体结构,也就是所谓的 MOS 管。MOSFET 有增强型和耗尽型两类器件,又可以分别分为 N 沟道与 P 沟道。

NMOS 的基本结构如  $\mathbf{81}$ ,一个低掺杂的  $\mathbf{P}$  型硅片为衬底,两个高掺杂的  $\mathbf{N}$  型阱区引出电极作为源极和漏极,覆盖一层二氧化硅绝缘层后再覆盖一层金属铝引出电极作为栅极。

#### 3.2 NMOS 电学特性

在栅极-源极不外加电压  $V_{GS}=0$  时,源漏之间是两个 PN 结,不存在导电沟道,因此  $V_{DS}\neq0$  时也不会有电流通过;在  $V_{GS}>0$  时,电压透过绝缘层作用到栅极下方,排斥其中的空穴,留下电离的杂质负离子形成了耗尽层,但是由于没有自由移动的载流子,因此仍然无法形成电流;当  $V_{GS}$  进一步增大,已经不存在可以排斥的空穴,因此吸引来了电子,形成了 N 型的层,也就是反型层,构成了导电的沟道。产生导电沟道的临界电压称为阈值电压  $V_{th}$ 。

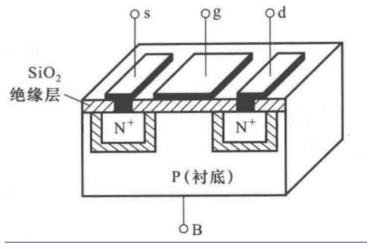


图 1: NMOS 基本结构

当  $V_{GS} > V_{th}$  时,源漏电压可以引起漏极电流。当  $V_{DS}$  较小时,未产生夹断,并且  $I_D$  随着  $V_{DS}$  线性变化,称为线性区;当  $V_{DS}$  较大时,沟道出现了夹断,进一步增大会造成夹断区的延长,而夹断区的长度变化几乎不会影响电流,电流几乎仅取决于  $V_{GS}$  ,此时称为饱和区。

对上述的直流特性进行总结,可以得到图2。

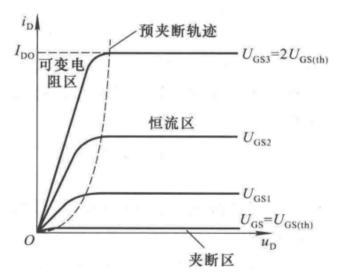


图 2: NMOS 输出特性曲线

由于工作在饱和区时,不同的 $V_{DS}$ 输出电流几乎相同,可用转移特性曲线进行描述饱和区的电流特性,如 $\{ {f B} {f 3} \}$ 。

### 3.3 操作步骤

#### 3.3.1 实验一: IRF3205 源漏伏安特性曲线

- 1. 将元器件连接到面包板,尽量减少杜邦线的使用。电路如图4
- 2. 连线完成后打开 ED 测试仪表是否工作正常
- 3. 调节  $E_D$  为 0-1.5V

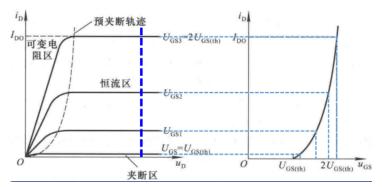


图 3: NMOS 转移特性曲线

### 4. 测量对应的 $V_{DS}$ 和 $I_D$ 并绘图

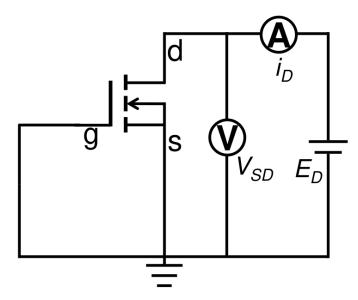


图 4: 实验一电路

### 3.3.2 实验二: IRF3205 转移特性曲线

- 1. 将元器件连接到面包板,尽量减少杜邦线的使用。电路如图5。
- 2. 连线完成后打开  $E_D$  和  $E_G$  测试仪表是否工作正常
- 3. 调节  $E_D$  为 0.5, 1, 1.5V
- 4. 分别将  $E_G$  在 0.1 7V 取值
- 5. 测量对应的  $V_{GS}$  和  $I_D$  并绘图

### 3.3.3 实验三: IRFR214 转移特性曲线

- 1. 将元器件连接到面包板,尽量减少杜邦线的使用。电路如图6。
- 2. 连线完成后打开  $E_D$  和  $E_G$  测试仪表是否工作正常
- 3. 调节 E<sub>D</sub> 为 1.0V
- 4. 分别将  $E_G$  在 0.1-10V 取值
- 5. 测量对应的  $V_{GS}$  和  $I_D$  并绘图

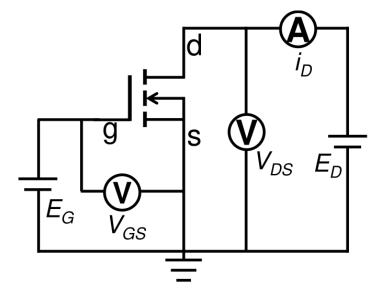


图 5: 实验二电路

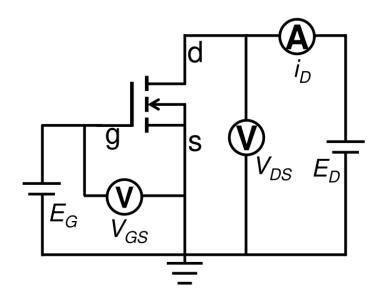


图 6: 实验三电路

### 3.3.4 实验四: IRFR214 输出特性曲线

- 1. 将元器件连接到面包板,尽量减少杜邦线的使用。电路如图7。
- 2. 连线完成后打开  $E_D$  和  $E_G$  测试仪表是否工作正常
- 3. 调节  $E_G$  为 3.3, 3.5, 3.7V
- 4. 分别将  $E_D$  在 0.1 2V 取值
- 5. 测量对应的  $V_{DS}$  和  $I_D$  并绘图

# 4 实验数据记录

原始数据请见 这里。

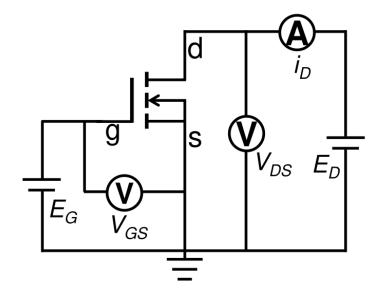


图 7: 实验四电路

## 4.1 实验一

IRF3205 源漏伏安特性曲线如图 8。

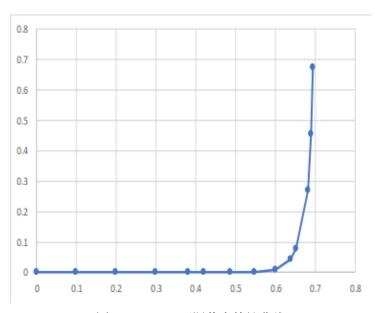


图 8: IRF3205 源漏伏安特性曲线

## 4.2 实验二

IRF3205 转移特性曲线如图 9。

## 4.3 实验三

IRFR214 转移特性曲线如图 10。

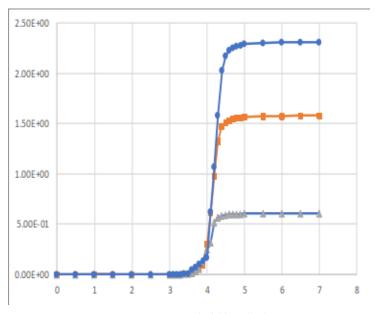


图 9: IRF3205 转移特性曲线

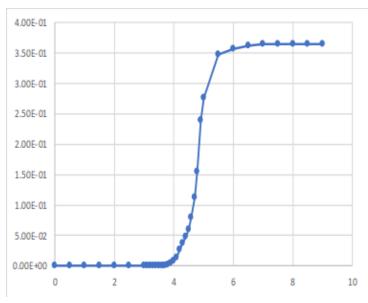


图 10: IRFR214 转移特性曲线

### 4.4 实验四

IRF3205 源漏伏安特性曲线如图 11。

# 5 实验结果分析

### 5.1 实验一

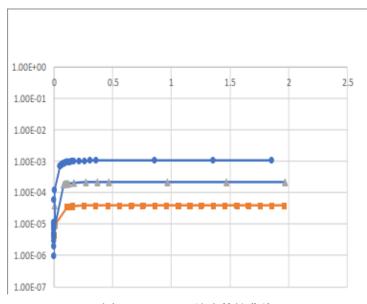


图 11: IRFR214 输出特性曲线

### 5.2 实验二

在  $V_{GS}$  较小时,器件处于截止状态,因此电流较小,不同的  $V_D$  对电流影响较小;稍大的  $V_{GS}$  使得器件工作在饱和状态, $V_{GS}$  对电流的影响是二次的,不同  $V_{DS}$  在可变电阻区的影响体现在饱和区的人口,也就是为什么同一  $V_{GS}$  下电流的大小不同;进一步增大,由于栅极电压过高,管子工作在线性区, $V_{GS}$  对电流的影响较小,因此很小的电流变化就涵盖了较大的  $V_{GS}$  区域。

### 5.3 实验三

同 5.2。

#### 5.4 实验四

在  $E_D$  较小时,电路处在线性区,电流较小;  $E_D$  增大时,逐渐进入线性区,电流迅速上升;继续增大,进入饱和区,电流几乎保持不变。较小的栅极偏置差距下,电流差距变化迅速,体现了平方增长的特点。

# 6 总结与思考

转移特性曲线变平的原因:此时由于栅极电压过高,管子工作在线性区, $V_{GS}$  对电流的影响较小,因此很小的电流变化就涵盖了较大的 $V_{GS}$  区域。

Q1. 请列举场效应管与双极型晶体管的几个不同点

- MOS 是压控器件, BJT 是流控器件, 因此 MOS 的功耗更低
- MOS 仅有多子参与导电, BJT 多子少子均参与, 因此 MOS 的温度性更好
- MOS 集成性好

Q2. 请根据转移特性曲线图画出输出特性曲线中的恒流区曲线示意图。如 图 12。

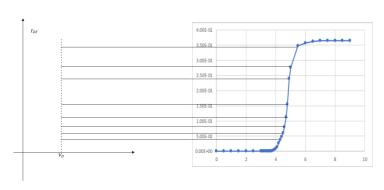


图 12: 恒流区曲线